

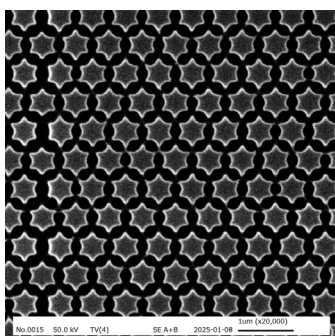


電子線リソグラフィによるナノパターン描画

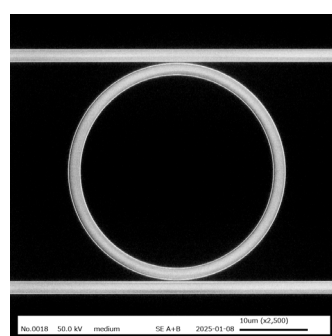
～ナノスケールの加工をお考えの方へ～



電子線描画装置



ナノ周期構造



マイクロリング共振器

日時

2026年6月30日(火)

～ 2026年7月13日(月)

(上記視聴期間内であれば、何回でも視聴可能です。)

申込締切日

2026年

6月16日

(火)

定員

20名

受講料

2,000円

特徴

- ・リソグラフィ技術を利用した微細加工プロセスについて、実験動画を交えて入門知識を解説します。
- ・電子リソグラフィ技術によるナノスケールの微細パターンを描画する技術をご紹介します。
- ・実際に利用する際に必要なCAD設計のノウハウ、装置描画パラメータの選定方法などを解説します。

詳細は裏面またはこちら



お問合せ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター お客様支援室 技術セミナー係
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308
メール宛先：kenshu@iri-tokyo.jp



地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター

TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

技術セミナー（オンデマンド配信）

電子線リソグラフィによるナノパターン描画～ナノスケールの加工をお考えの方へ～

概要

ナノスケールの微細な構造体を加工する際、試作開発段階では電子線リソグラフィによるパターンニング技術が広く利用されています。前半では、リソグラフィ技術を利用した微細加工の概要、電子線描画装置を用いたナノスケールのパターンニングに関する基礎知識を解説します。後半では、電子線リソグラフィ技術を実際に活用する際に必要となるノウハウについて、具体的なアプリケーション応用事例の紹介や、電子線描画装置用パターン（CAD データ）の設計手法、所望のナノスケール構造体を得るために最適な装置仕様（スペック）や描画条件を選定するための知識を解説します。電子線リソグラフィによるナノスケール微細加工をご検討中の方や、電子線リソグラフィ技術について理解を深めたい方のお申込みをお待ちしております。

※本配信の内容は、昨年度に配信した同タイトルと同様です。

プログラム

動画の長さ	タイトル	講師（担当者）
25分	『リソグラフィ技術の概要と電子線リソグラフィの原理』 ■リソグラフィによる微細加工プロセスの概要 ■電子線リソグラフィ技術の概要	東京都立産業技術研究センター 固体デバイス技術グループ 宮下 惟人 リソグラフィ工程の技術支援に従事
75分	『電子線リソグラフィ実践活用セミナー』 ■電子線リソグラフィを活用した事例について ■図形フォーマットと作図について ■描画処理のスループットについて	Bush Clover株式会社 新関 嵩 氏 ナノ・マイクロデバイスの設計、開発、 微細加工全般の受託開発事業に従事

募集要項

- 利用約款** 下記ウェブページでご確認ください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/>
- 応募資格** 原則として、日本で設立登記された法人、個人事業主または創業を予定している個人
国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これらに準ずる公的機関
- 申込方法** 下記ウェブページの申込フォームから、お申込みください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar-event/seminar-260630-0713/>
- 受講可否** 受講予定者には、請求書およびコンビニ払込書を郵送いたします。
定員などの関係で受講をお断りする場合、電話また電子メールでご連絡いたします。

参加方法

- 動画を視聴するには、オンデマンド配信サイトへのアカウント登録が必要です。お申込み後、自動返信メールに記載されている URL からご登録ください。過去にアカウント登録済みの方は、改めての登録は不要です。配信期間になりましたら、サイト上に動画が表示されます。
- 視聴環境(パソコンなど)は、受講者をご準備ください。
- ブラウザは、Microsoft® Edge^{※1}または Google chrome^{TM※2} をご使用ください。
^{※1※2}Microsoft® Edge はマイクロソフト社の登録商標で、Google chromeTM はグーグル社の商標です。